

第 12 回偏光計測研究会開催のご案内

本研究会は、エリプソメトリーやポラリメトリーに代表される偏光を用いた計測技術に関して議論と情報交換を行い、この技術分野における日本の研究開発を活性化し、そのレベルを向上しようとする集まりです。

2007 年 11 月から活動を開始し、半年毎に研究会を開催しております。これまでに東北大学（仙台）、産業技術総合研究所（つくば）、北海道大学（札幌）、横浜市立大学（横浜）、山梨大学（甲府）、宇都宮大学（宇都宮）、東京工芸大（東京）、堀場製作所（東京）、東京都立産業技術研究センター（東京）、独立法人物質・材料研究機構（つくば）、フォトロン（東京）と計 11 回開催されてきました。

今回は、チュートリアル講演では大阪府立大学 菊田久雄先生「ナノ構造による複屈折制御と偏光素子の設計」を、招待講演では東京大学 横井秀俊先生「射出成形現象の可視化実験解析 ―可視化技術と定量評価手法―」と有限会社 プリントアート 島崎 勝信氏「工業用の偏光板をアートの世界に」をお招きしました。講演会終了後に偏光技術者・研究者間の交流を深めることを目的とした懇親会を開催予定です。

偏光計測にご関心をお持ちの多くの皆様のご参加をお待ちしております。

参加ご希望の方は、下記申込書にご記入の上お申込みください。

その際に、懇親会に参加ご希望の方も一緒にご記入ください。

- ・日時：2016 年 7 月 20 日 水曜日
- ・場所：東京都立産業技術研究センター
〒135-0064
東京都江東区青海 2-4-10
本部 2F イノベーションハブ
<http://www.iri-tokyo.jp/gaiyo/access/honbu.html>
- ・参加費：一般 3,000 円、学生 300 円（当日払）、懇親会参加費 3,000 円（予定）

-----プログラム-----

9:50-10:00（10 分） イントロダクトリートーク

清水研一（都産技研 先端材料開発セクター長）

10:00-11:00（60 分） 【講演 1】（招待講演 1）

射出成形現象の可視化実験解析 ―可視化技術と定量評価手法―

横井 秀俊（東京大学）

11:00-11:25(25 分) 【講演 2】

樹脂成形品の偏光観察による異方性評価と動的粘弾性測定の利用

小坂耕平(サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社)

11:25-11:50(25 分) 【講演 3】

高分子のラマンスペクトル

奈良明司，春井里香，澤田寛己（サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社）

11:50-13:05 (75分) 昼食休憩

13:05-14:05 (60分) 【講演 4】(招待講演 2)

工業用の偏光板をアートの世界に

島崎 勝信 (有限会社 プリントアート)

14:10-14:35 (25分) 【講演 5】

偏光イメージングのための多角的撮像システムの開発と応用研究

村越英樹, 滝克彦, 笹尾英樹, 金田桂一, 小坂耕平(産業技術大学院大学)

14:35-15:00 (25分) 【講演 6】

偏光と非偏光

川畑州一(東京工芸大学)

15:00-15:15 休憩

15:15-15:40 (25分) 【講演 7】

6個の光電検出器によるリアルタイム・ストークス偏光計

柴田秀平, 川畑州一*, 大谷幸利 (宇都宮大学, 東京工芸大学*)

15:40-16:05 (25分) 【講演 8】

半導体露光装置の偏光評価

野村博 (株式会社東芝 ストレージ&デバイスソリューション社)

16:05-16:30 (25分) 【講演 9】

Ellipsometric Characterization of Anisotropy in LCD: From the Surface of Rubbed PI to Distribution of LC molecules in TN cell

Sang Youl KIM(Ajou University)

16:30-17:30 (60分) 【講演 10】(チュートリアル 1)

ナノ構造による複屈折制御と偏光素子の設計

菊田 久雄 (大阪府立大学)

17:30-17:35 (5分) クロージング・リマークス

大谷幸利 (宇都宮大学)

17:45-20:00 懇親会

都産技研 5F 食堂 (参加費 3000円)

お問い合わせ

〒321-8585 栃木県宇都宮市陽東 7-1-2

宇都宮大学オプティクス教育研究センター 大谷研究室内

一般社団法人日本光学会 偏光計測・制御技術グループ 事務局

TEL&FAX 028-689-7136

email : psi-info(at)opt.utsunomiya-u.ac.jp

第 12 回偏光計測研究会 参加申込書

下記内容をご記入頂き psi-info(at)opt.utsunomiya-u.ac.jp 宛にお願いいたします。

締切：~~7月8日(金)~~ 当日申し込み可能（できるだけ事前申し込みをお願いします）

●ご氏名：

●ご所属：

●ご連絡先：

=====

<懇親会>（場所（所内食堂），参加費（3,000 円予定））

ご出席 ・ ご欠席